

Учебно-методическая литература по дисциплине «Современные технологии MEMS компонентов»

- 1) Броудай И., Мерей Дж. Физические основы микротехнологии. - М.: Мир, 1985. 494 с.
- 2) Черняев В.Н. Физико-химические процессы в технологии РЭА. - М.: Высшая школа, 1987. - 375 с.
- 3) Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии: учеб. пособие /пер. с англ.Ю.И. Головина. -2-е изд., доп. – М.: Техносфера, 2006. - 336 с.
- 4) Штернов А.А. Физические основы конструирования, технологии РЭА и микроэлектроники. - М.: Радио и связь, 1981. - 248 с.
- 5) Аброян И.А., Андронов А.Н., Титов А.И. Физические основы электронной и ионной технологии. - М.: Высшая школа, 1984. - 320 с.
- 6) Колобов Н.А. Основы технологии электронных приборов. - М.: Высшая школа, 1980. - 288 с.
- 7) Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы наноэлектроники /учеб. пособие. - М.: Логос; Физ.-мат. книга, 2006. - 494 с.
- 8) Иваненков Г.В. и др. Динамика плазмы взрывающихся проволочек /ЖЭТФ. 1994. Т. 114. Вып. 4(10). С. 1216-1229.
- 9) Карабанов С. М., Локштанова О. Г. Исследование комплексного состава сульфатных электролитов рутенирования/ Журнал прикладной химии. Т. 81. Вып. 6. 2008. С. 961 – 964.
- 10) Безрядин Н.Н. и др. Получение тонких плёнок полупроводниковых соединений в квазизамкнутом объёме /ПТЭ. №5. 1998.С. 150-153.
- 11) Чижиков А.Е. и др. Исследование возможности получения пленок равномерной толщины на подложках больших размеров //Электронная техника. Сер. 7. ТОПО. Вып. 6 (133). 1985. С. 13-16.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей Александрович, Заведующий
кафедрой ПЭЛ

13.09.24 14:33 (MSK)

Простая подпись